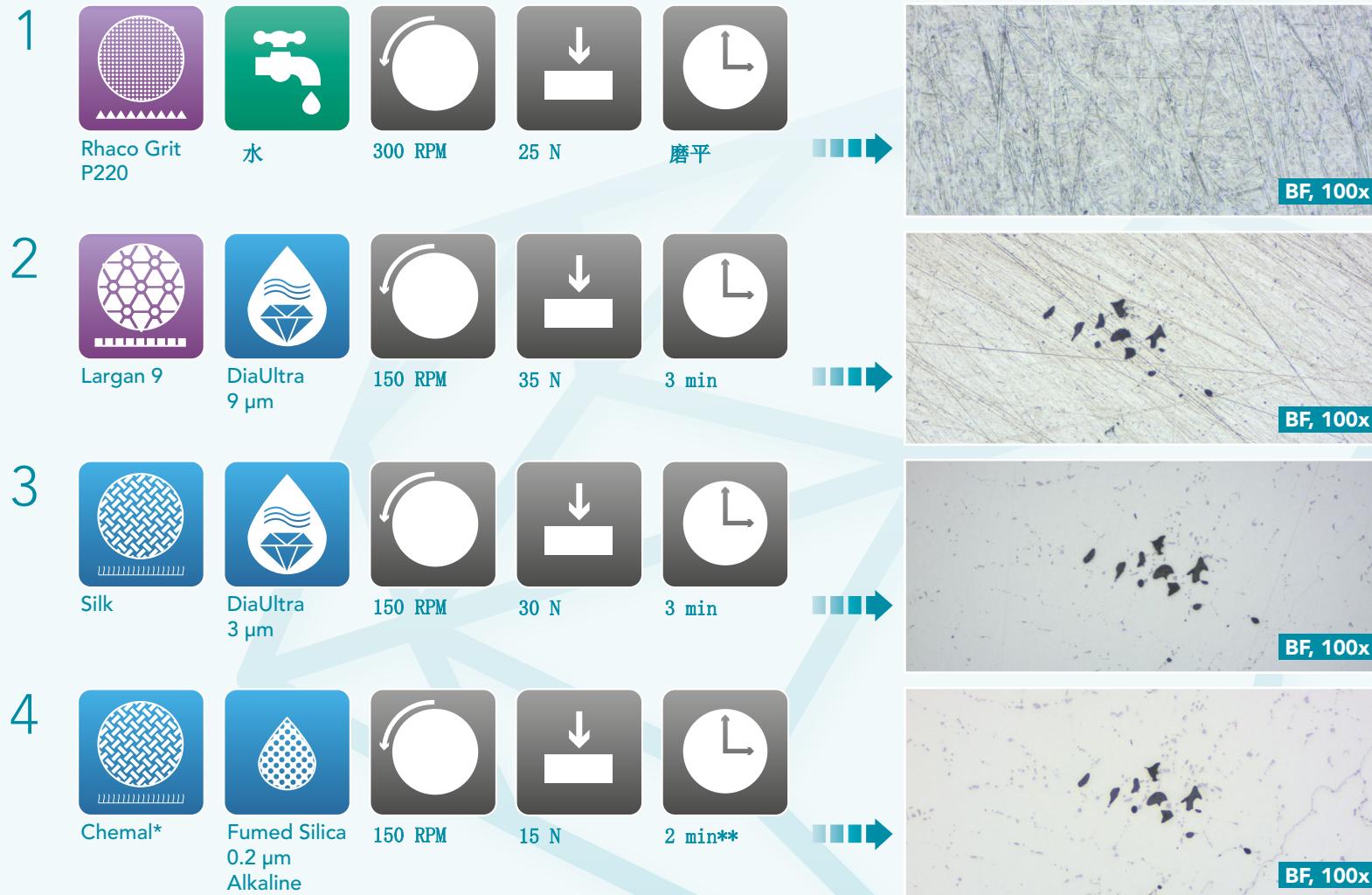


Aka-Brief #20 超级合金



图中所示时间与压力均适用于标准的300毫米制样系统和40毫米直径样品。

使用250毫米制样系统时，时间相应增加30%；使用200毫米制样系统时，时间相应增加 100%。

所使用的压力应随样品尺寸的增大和减小而进行相应的增大和减小。

样品夹/样品移动盘的转速为150转/分钟。

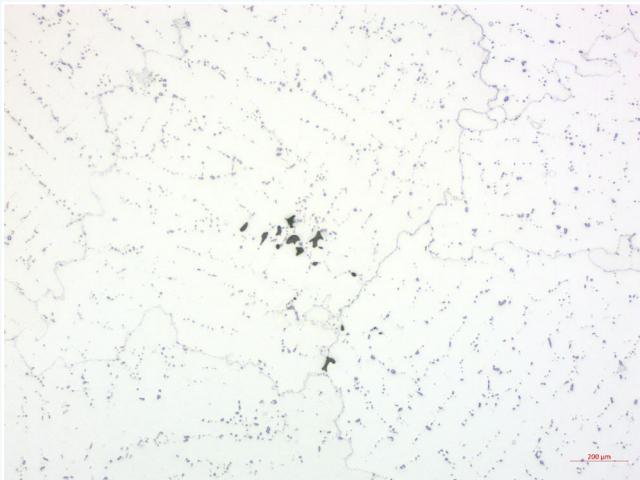
样品制备所需的时间和压力可能根据制样设备的不同而有所变化。

*开始氧化抛光之前，加水使整片抛光布湿透，样品夹/样品移动盘下移接触到抛光布时，停止加水。在氧化抛光的最后10秒，加水冲洗样品和抛光布。

**如果需要从孔隙中去除残留金属，最后的抛光步骤可以增加2分钟。长时间的氧化抛光会增加腐蚀的效果，从而使得后续的腐蚀过程更容易进行。

Aka-Brief #20 超级合金

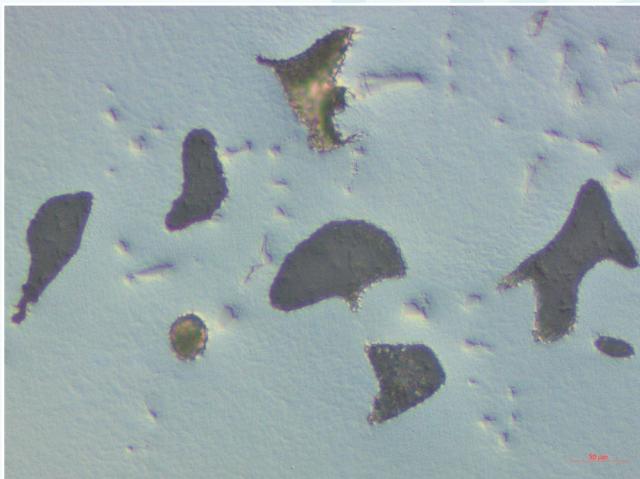
最终制样结果



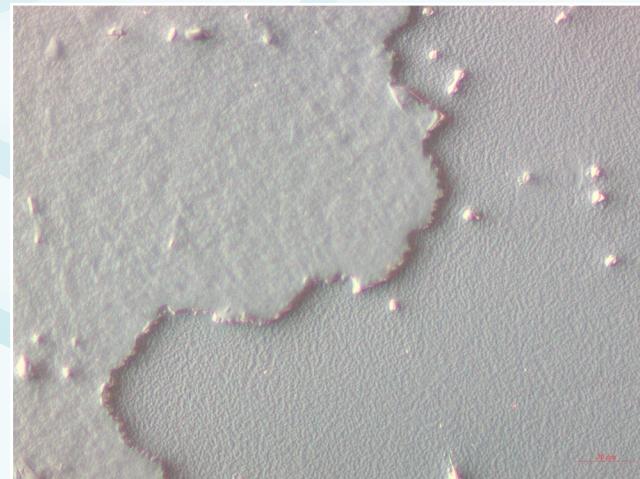
超级合金中的孔隙，明场像，50倍



超级合金中的孔隙，微分干涉衬度像，500倍



超级合金中的孔隙，微分干涉衬度像，500倍



超级合金，微分干涉衬度像，500倍